

06.3

© 1990

ДЛИННОВОЛНОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ
ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y|InAs$

($\lambda = 3.0\text{--}4.8$ мкм при 300 К)
с широкозонным „окном”

А.Н. Б а р а н о в, А.Н. И м е н к о в,
О.П. К а п р а н ч и к, В а л е р. В. Н е г р е с к у л,
А.Г. Ч е р н я в с к и й, В.В. Ш е р с т н е в,
Ю.П. Я к о в л е в

1. Создание длинноволновых светоизлучателей на основе $InAs$ [1] и твердых растворов $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ [2] в области длин волн от 3 до 5 мкм стимулировало развитие полупроводниковых излучателей для оптоэлектронных устройств, волоконно-оптических линий связи третьего поколения [3] и газового анализа [4]. Это обусловило, в частности, появление светодиодов на основе гомо-р-п-переходов в $InAs$ [1], твердых растворах $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ [2, 5] и $InAs_{1-x}Sb_x$ [6], близких по составу к $InAs$, и двойных гетероструктурах (ДГС) типа п- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ /п- $InAs$ /р- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ [7, 8] и N- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ /п- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ /р- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ [9].

Твердые растворы получались методом жидкофазной эпитаксии.

На эффективность излучательных переходов в р-п-структуратах на основе $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ влияют неизбежные появления упругих напряжений в эпитаксиальных слоях [10, 11] и безызлучательные Оже-процессы [8, 12]. Теоретический расчет [8, 13, 14] с учетом безызлучательных Оже-процессов и экспериментальные исследования [8] внутреннего квантового выхода излучения γ_{int} в $InAs$ показали, что при изменении температуры от 77 до 300 К γ_{int} падает от ~ 96 до $\sim 3\%$. Малая эффективность излучения при 300 К затрудняет создание источников стимулированного излучения в области 3–5 мкм. Во всех структурах наблюдалось сильное самопоглощение излучения из-за близости состава твердых растворов к $InAs$.

Целью данной работы явилось создание гетеро р-п-структур п- $InAs$ /п-р- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ /р- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ с широкозонным оптическим „окном“ для вывода излучения и исследования влияния концентрации доноров (Sn) и акцепторов (Zn) в слоях структуры на эффективность излучательной рекомбинации.

2. Исследуемая светодиодная структура (рис. 1, а) имела вариационный активный слой п-р- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$, заключенный между подложкой п- $InAs$ и широкозонным оптическим „окном“ из

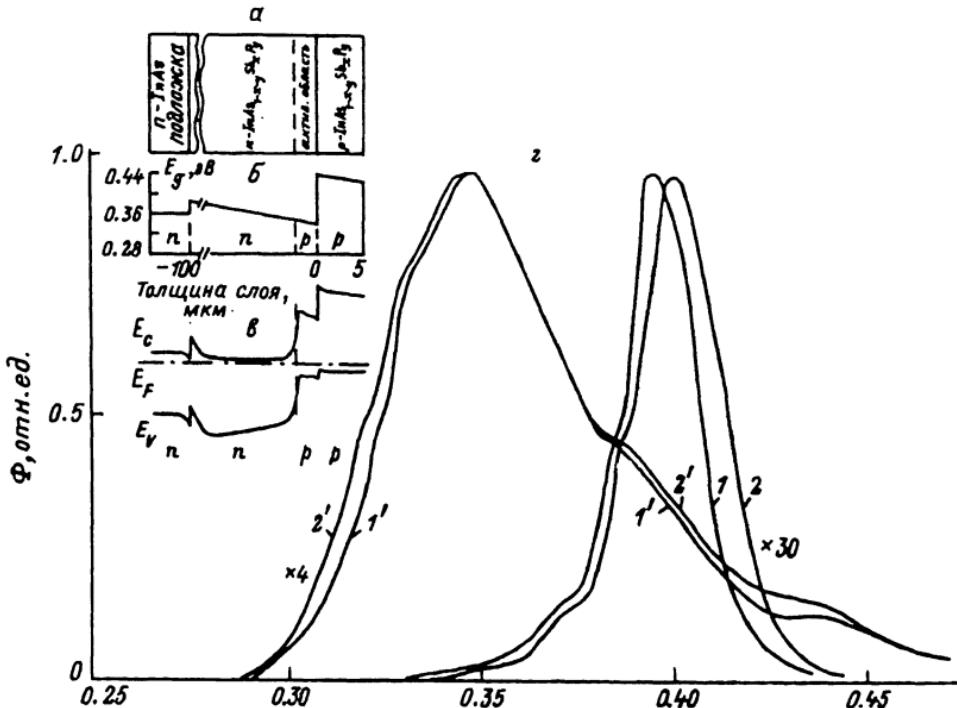


Рис. 1. Структура и электролюминесцентные характеристики светодиодов на основе $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$: а - структура светодиода, б - зависимость E_g от толщины слоев, в - энергетическая диаграмма структуры, г - спектры электролюминесценции при 300 К (кривые 1' и 2') и при 77 К (кривые 1 и 2); кривые 1 и 1' соответствуют светодиодной структуре, монтированной на держателе р-областью, а кривые 2 и 2' - структуре, монтированной на держателе п-областью.

слоя $p\text{-}InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$. Ширина запрещенной зоны E_g в активном слое (рис. 1, б, в) уменьшалась в направлении от подложки от 0.38 до 0.344 эВ при 300 К. Широкозонное „окно“ имело $E_g = 0.44$ эВ при 300 К. Толщина слоев твердых растворов составляла соответственно 100 и 5 мкм. Р-п-переход находился на расстоянии от 0 до 3–6 мкм от широкозонного „окна“.

Слои твердых растворов создавались жидкостной эпитаксией. В качестве подложки использовались пластины нелегированного п- $InAs$ (100) с концентрацией электронов $\sim 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Варизонный активный слой п- $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$, выращивался при уменьшении температуры от 650 до 615 °C без специального легирования либо легированным Sn в интервале от $(2-5) \cdot 10^{16}$ до $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Широкозонное „окно“ выращивалось при уменьшении температуры от 615 до 610 °C и легировалось Zn в интервале $10^{16}-5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Р-п-переход формировался в вари-

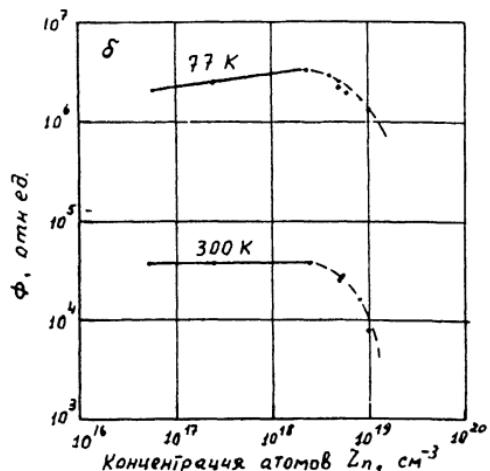
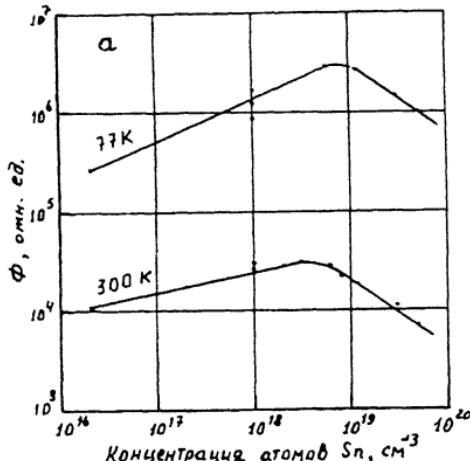


Рис. 2. Зависимость интенсивности излучения Φ от концентрации примесных атомов: а - олова, б - цинка.

зонном активном слое за счет диффузии Zn во время выращивания широкозонного „окна“. Состав твердых растворов определялся с помощью количественного рентгеноспектрального микроанализа на микроанализаторе JXA-5 „CAMEBAX“ фирмы *Cameca* (Франция).

Из эпитаксиальных структур после удаления подложки изготавливались светодиоды с площадью $0.15 \times 0.15 \text{ mm}^2$ методом фотолитографии. Светодиодная структура монтировалась на держатель либо n-, либо p-областью.

Исследовались спектры электролюминесценции, характеристики ток-напряжение и интенсивность излучения — ток светодиодов при температурах 77 и 300 К. В качестве монохроматора использовался МДР-12. Приемником излучения служило фотосопротивление из $InSb$, охлаждаемое до температуры 78 К. Измерения проводились в интервале плотностей тока от 10 до 10^5 A/cm^2 .

3. В типичных спектрах излучения структур с концентрацией S_{Sn} и Zn в эпитаксиальных слоях менее 10^{18} cm^{-3} (рис. 1, г) преобладает полоса с энергией максимума $h\nu_{max}$, близкой к минимальной ширине запрещенной зоны узкозонного слоя E_{gmin} , как при комнатной температуре, так и при 77 К. Наряду с преобладающей полосой в спектрах излучения проявляются длинноволновые полосы с $h\nu_{max} < E_{gmin}$ на 20 и 30 мэВ, доля которых увеличивается с ростом концентрации примесных атомов Zn и Sn . Эти длинноволновые полосы становятся преобладающими при концентрации атомов цинка более 10^{17} cm^{-3} для первой полосы и атомов цинка и олова более $5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ — для второй полосы.

При комнатной температуре форма спектра почти не зависит от того, какой стороной (p- или n-типа) структура смонтирована на держателе. На коротковолновом склоне полосы наблюдается небольшая немонотонность спада интенсивности излучения с ростом $h\nu$, дающая избыток излучения при $h\nu \approx 0.39 \text{ эВ}$ и дефицит при $h\nu \approx 0.42 \text{ эВ}$.

При 77 К полоса с $\hbar\nu_{\max}$, близкой к E_{gmin} , смещается на ~5 мэВ в сторону малых энергий в структурах, смонтированных на держатель р-областью, относительно полосы излучения структур, смонтированных противоположной стороной (рис. 1, г, кривые 1 и 2). В интервале токов 0.02–5 А интенсивность излучения пропорциональна току.

Содержание примесных атомов цинка и олова в структуре по разному влияют на внешний квантовый выход излучения (рис. 2, а и б). Увеличение концентрации атомов олова в узкозонном слое от 10^{16} до $8 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ при фиксированном содержании концентрации атомов цинка $5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ в широкозонном слое р-типа приводит к росту квантового выхода излучения в 5–10 раз. При этом преобладает полоса излучения с $\hbar\nu_{\max} \approx E_{gmin}$. Дальнейшее увеличение концентрации атомов олова приводит к уменьшению квантового выхода излучения и преобладанию полосы излучения с $\hbar\nu_{\max} < E_{gmin}$ на 30 мэВ. При концентрациях атомов цинка в широкозонном слое меньше $2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ преобладает полоса с $\hbar\nu_{\max} \approx E_{gmin}$ и квантовый выход излучения остается неизменным. Увеличение концентрации атомов цинка более $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ приводит к снижению квантового выхода излучения и преобладанию полосы излучения с $\hbar\nu_{\max} < E_{gmin}$ на 20–30 мэВ в зависимости от содержания атомов олова в узкозонном слое.

4. Проанализируем экспериментальные результаты. Преобладание полосы излучения с $\hbar\nu_{\max}$, близкой к E_{gmin} , в структурах с малым содержанием олова и цинка ($< 10^{18} \text{ см}^{-3}$) (рис. 2) свидетельствует, что в этих структурах излучение обусловлено квазимежзонными переходами в узкозонном слое, причем преобладает инъекция электронов из п-области в р-область, и инжектированные электроны локализуются в узкозонной области варизонного слоя между р-п-переходом и широкозонным оптическим „окном“.

Более длинноволновые полосы излучения с $\hbar\nu_{\max} < E_{gmin}$ на 20 и 30 мэВ, преобладающие при больших концентрациях цинка и олова, естественно связать с переходами зона проводимости – акцепторный уровень цинка и донорный уровень олова – акцепторный уровень цинка соответственно, основываясь на величинах энергии излучаемых фотонов и связи интенсивности излучения в этих полосах с концентрацией примесных атомов.

Уменьшение внешнего квантового выхода излучения с увеличением доли примесного излучения показывает, что внутренний квантовый выход излучения при межзонной рекомбинации больше, чем при примесной.

Роль широкозонного „окна“ особенно отчетливо проявляется при низких температурах, когда электроны могут локализоваться в узком слое вблизи упомянутой гетерограницы. При этом регистрируется практически неискаженный поглощением спектр электролюминесценции.

При комнатной температуре эффект широкозонного „окна“ завуалирован большой величиной фермиевского размытия электронов по энергиям, в результате которого значительная часть излучения генерируется вдали от гетерограницы.

Немонотонность спада интенсивности излучения с ростом энергии фотона в спектре излучения при комнатной температуре можно объяснить поглощением высокоэнергетических фотонов в объеме широкозонного „окна“ и толще π-области и последующим переизлучением со стоксовским сдвигом. Основаниями для такого объяснения являются величина энергий фотонов в экстремумах избытка и дефицита излучения и независимость от тока амплитуды отклонения от монотонности. Оценки показывают, что при комнатной температуре не более десятой доли излучения поглощается в широкозонном „окне“ и варизонной π-области.

Таким образом, излучательная рекомбинация в светодиодах на основе $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ с варизонным узкозонным слоем и широкозонным оптическим „окном“ происходит в основном в узкозонной части варизонного слоя, квазимежзонная рекомбинация обладает более высоким квантовым выходом излучения, чем рекомбинация через примесные состояния цинка и олова, широкозонное оптическое „окно“ обладает удовлетворительной прозрачностью.

Получен внешний квантовый выход излучения 30% при 77 K и 0.5% при комнатной температуре.

Список литературы

- [1] M e l n g a i l i s I., R e d i k e r R.H. // J. Appl. Phys. 1966. V. 37. N 2. P. 899-911.
- [2] Е с и на Н.П., З о т о в а Н.В., М а т в е е в Б.А., С т у с ь Н.М., Т а л а л а к и н Г.Н., А б и ш е в Т.Д. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. № 7. С. 391-395.
- [3] G o o d m a n C.H.L. // Sol. St. Electron. Dev. 1972. V. 2. N 3. P. 129-137.
- [4] Красов В.И., М а л е й к о Л.В., Ц в е т к о в В.А., Ю р е в и ч Е.И. Газоанализатор. А.С. № 569916. Опубл. в БИ. № 31. 1977.
- [5] З о т о в а Н.В., Карапашев С.А., М а т в е е в Б.А., С т у с ь Н.М., Т а л а л а к и н Г.Н. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. № 23. С. 1444-1447.
- [6] А и д а р а лиев М., З о т о в а Н.В., Карапашев С.А., М а т в е е в Б.А., С т у с ь Н.М., Т а л а л а к и н Г.Н. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 6. С. 329-332.
- [7] А и д а р а лиев М., З о т о в а Н.В., Карапашев С.А., М а т в е е в Б.А., С т у с ь Н.М., Т а л а л а к и н Г.Н. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 9. С. 563-565.
- [8] А и д а р а лиев М., З о т о в а Н.В., Карапашев С.А., С т у с ь Н.М. // ФТП. 1989. Т.23. В. 4. С. 592-596.
- [9] К о в а ў а с h i N., H o r i k o s h i Y. // Jap. J. Appl. Phys. 1980. V. 19. N 10. P. 1641-1644.

- [10] Айдарайлиев М.Ш., Зотова Н.В., Карапандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь Н.М., Талакин Г.Н. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 17. С. 1617-1621.
- [11] Матвеев Б.А., Петров В.И., Стусь Н.М., Талакин Г.Н., Шабалин А.В. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 7. С. 1244-1247.
- [12] Андрушко А.И., Салихов Х.М., Слободчиков С.В., Стусь Н.М., Талакин Г.Н. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 5. С. 789-792.
- [13] Sugimura A. // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. N 8. P. 4405-4411.
- [14] Sugimura A. // IEEE J. Quantum Electron. 1982. QE-18. N 3. P. 352-363.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
8 июня 1990 г.